

SUBSTRATE ADSORPTION METHOD, SUBSTRATE HOLDING APPARATUS,
SUBSTRATE POLISHING APPARATUS, ELASTIC FILM, SUBSTRATE ADSORPTION
DETERMINATION METHOD FOR SUBSTRATE HOLDING APPARATUS, AND PRESSURE
CONTROL METHOD FOR SUBSTRATE HOLDING APPARATUS

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 基板を適切に扱うための基板吸着方法、基板保持装置、基板研磨装置、弾性膜、基板保持装置における基板吸着判定方法および圧力制御方法を提供する。

【解決手段】 トップリングに基板を吸着させる基板吸着方法であって、基板の下面が支持部材に支持され、基板の上面が弾性膜の下面と接触した状態で、弾性膜の上面とトップリング本体との間に同心円状に形成された複数のエリアのうちの少なくとも1つのエリアを真空引きする真空引き工程と、真空引きの対象エリアより外側にあるエリアにおけるガスの流量を計測する流量計測工程と、ガスの流量に基づいて、トップリングに基板が吸着したか否かを判定する判定工程と、トップリングに基板が吸着したと判定された後に、基板が吸着された弾性膜と支持部材とを離間させる離間工程と、を備える基板吸着方法が提供される。

【選択図】 図 7 A